

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета университета №7

Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19 Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г. Владелец: проректор по учебной работе А.В. Гаврилов

министерство науки и высшего образования российской федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Институт информатики, математики и электроники

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

11.03.03

<u>Направление 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств</u>
<u>Профиль "Проектирование и технология радиоэлектронных средств"</u>

Кафедра: Кафедра конструирования и технологии электронных систем и устройств

Квалификация: бакалавр	Год начала подготовки (по учебному плану) <u>2020</u>
Программа подготовки: бакалавриат	
Форма обучения: Заочная	Образовательный стандарт Приказ Министерства образования и науки Российской
Срок обучения: 4 г 8 мес	<u>Федерации №928 от 19.09.2017. Зарегистрировано в</u>
	Минюсте России 12.10.2017 №48537

Код	Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты	Приказ Минтруда	Зарегистрировано в Минюст
25	РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ		
25.024	СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 244н от 17.04.2018 г.	08.05.2018 г. № 51032
25.027	СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ АППАРАТУРЫ БОРТОВЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	№ 973н от 03.12.2015 г.	31.12.2015 г. № 40456
25.036	СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ УПРАВЛЕНИЯ	№ 979н от 03.12.2015 г.	31.12.2015 г. № 40471
25.043	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ ПРИБОРОВ И КАБЕЛЕЙ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 920н от 01.12.2015 г.	31.12.2015 г. № 40458
29	ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
29.005	СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ В КОРПУСЕ	№ 528н от 19.09.2016 г.	30.09.2016 г. № 43887
29.006	СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ В КОРПУСЕ	№ 519н от 15.09.2016 г.	27.09.2016 г. № 43832

+	Основной	Виды деятельности
+	+	научно-исследовательский
+	-	технологический
+	-	проектный

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе	/ Гаврилов А.В./
Начальник учебно-методического управления	/ Соловова Н.В.
Директор института	/Сергеев В. В./

Наменсками Эспинн	Saver Saver C 80 80	Skingth day 4scor	Dicting To many Kontact 1904	O Korgon se	. Horo Jac Jac	6 np KD KD	О Контраль	se itos fec	nd n 10 10	60 D 600	gana sa itoso	Ass Ass No	ко- ки с	9 forgon 14	Proc Ass Add	5 10 m	O torqua	sa. Muso Sec Se	4 h 10 101	O Rompus	sa itsus fax f	m	O Kompon sa	itoro Sec Sal	n _p kor kon	O Borpon 14.	Meso Sex Sed Sp	100 100 O 100	opone s.e. iftoro Sex	Au6 No KO KO1	J OP Nortpose	s.e. ifrom Rec	246 Dp KD KD1	CP Kompon F	Эд Наменование
																==															==	===		豊	
1234 15pa 1 23		2 2 3 1 1 2 2 2	720 720 49 144 144 12 554 504 40	620 C S 119 13 4 438 26 02	196 4 144 2 10 2	12 2	129 13	5 124	1 2	219	0 5 86	4 12	2 2	SS 12 S	124		155 13			\rightarrow	\rightarrow									_	=	\Rightarrow	$\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$	+	4 Géogra sucuré retrienteux (CSC-) 4 Géogra sucuré retrienteux (CSC-) 40 Géogra System 40 G
S CONSTRUCTION OF THE STATE OF	,	1 1 %	108 108 12 108 108 12	60 0	6 2 4			1 10	4 2							_		3 108 2 8	2	£3 13											+	=	\pm		 Кафеда сонов конструирования нашен ОПК I: ОПК II Кафеда конструирования и технологии опк 2 опк 2.
и твердого тела	4				+ + + + + +			- - - - - - - - - - 	' ' '	+-	- 6	2 4		- 4	130 0	2	120 8		 				 	 	 	 					+	$\overline{}$	+	+++	завстронных систем и устройств Кафедра конструирования и технологии ОТИ-2
HARD TRENCOCKE	1	3 3 36	344 344 35 308 308 36 344 344 35	94 B 3	109 2 12	2 2	94 S		-	\rightarrow	+			-		-	 	-			-	-	-	-		$\overline{}$	-		$\overline{}$		+	\rightarrow	$\overline{}$	+	60 STREET, CANTON A VICTORICE 60 STREET, CANTON A VICTORICE 60 STREET, CANTON A VICTORICE 61 STREET, CANTON A VICTORICE 62 STREET, CANTON A VICTORICE 63 STREET, CANTON A VICTORICE 64 STREET, CANTON A VICTORICE 65 STREET, CANTON A VICTORICE 66 STREET, CANTON A VICTORICE 67 STREET, CANTON A VICTORICE 68 STREET, CANTON A VICTORICE 69 STREET, CANTON A VICTORICE 60 STREET, CANTON A VICTORICE
		4 4 %	344 344 35 344 344 35	115 13 4	144 2	12 2	115 13		$\overline{}$		$\overline{}$					_	$\overline{}$				$\overline{}$								4 144 2	12 2	115 13	=	$\pm \pm \pm$		/ Сафеда инжинерной графики ОПК-4 ка Кафедра конструирования и технологии опку, и опку,
рукрования электронных средств 9		6 6 36	216 216 24	166 17	+++	 		 	$\overline{}$	-	+			+	$\overline{}$	-	 	-	 		-			2 2	 	2	20 4	2 %	8 4 144 2	8 4 2 9	110 9	$\overline{}$	++-	+++	вляктронных систем и устройств Кафера исиструарования и технологии опи-2; опи-1 кафера исиструарования и технология
		4 4 36	144 144 15	115 13	6 2 4	g 2		4 136	9 2	115	2			$\overline{}$		=	$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$	$\overline{}$									\rightarrow	=	$\overline{}$	+	+	J. Gobegos sonas: OTRC ; OTRC ; OTRC ; OTRC ;
per rocce, ececupi ecroper) 1		1 1 3	206 216 34 344 344 35 108 208 56 108 208 56	79 13			7 4		\rightarrow	\rightarrow	6	6		3	102	1 2	79 13				\rightarrow										\pm	\pm	##	##	JS Subjection Mr.1; W.5
max 1						2		2,75 98	8 2	80	8 4 144	16	2 1	13 13		\leftarrow	+++		+	\rightarrow			\vdash	++	-	$\overline{}$	-	$\overline{}$	+	-	+++	\rightarrow	+++	+++	2 русского как иностранного W.4; УК-5
роктани в профессиональной	4	2 2 %	108 108 16 72 72 12 334 354 35 144 344 16 72 72 10	0 0	+++	+++		 	+	+	1 100	. . 	1 1	7 2	$\overline{}$	-+-	+ + +	4 4	 	-	, ,	6 7	0 4	 	 	 	- - - - - - - - - - 	 	- - - 		+	+	++-	+ + + + ,	жизнерительности со Каферра конструирования и технологии _{МК-2} , мк ₋₂ , м ₋₂ , у
a 4	3 5	9 9 %	224 224 36	250 21	+	+			\rightarrow	\rightarrow	3,25 118	4 8 8	2 1	11 1 4/5	170 8	2	167 13	1 36	2 2 9	23		++++								##	\pm	$\Rightarrow \Rightarrow$	$\Rightarrow \Rightarrow =$	3	Заметорина систем и истройств 26 Кафида электротионня 27 К. 1, ОПК. 1, ОПК. 1
S S		4 4 %	72 72 10	115 13 54 0 2	72 4	4 2	54 0		+	+	+			-		\rightarrow	+++	4 144 2 5	1 1 2	115 13	-		-			-				$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	+++	+++	+++	++++	алектронных систем и устройств ОПК-1; ОПК-2 оп Сафедра конструирования и технологии ОПК-1; VK-1
ий дизайн	6	2 2 36	72 72 8	56 B	1 1 1	1.1.			-	-				-		-	1 1 1	2 2			2 70	4 2	56 B								+	\rightarrow	+++	+	алактронных систем и устройств Сафара изиструарования и технологии отк4
организация производства В ультура и спорт	1	1 1 36 2 2 36	109 109 12 72 72 2	93 13 66 4 2	72 2	+	66 4		\rightarrow	\rightarrow	+			-		=	-	-	-		-	-		6 2	1	2	352 4	2 63	D .	20 4 4 9	++	\rightarrow	++	+	7 Кафера организации производства W.S.W.30.3 21 Кафера физиспитания W.6; W.7
ни образовательных отношений	6	109 109	3924 3924 410	177 219 22.5	966 28 28	1 2 и	672 72	21.5 754	28 4 10	657	S 2.X 100	24 40 22	20 6	S4 @ 16.75	584 15	12 8	521 47	8 264 10 1		221 36	4 126	20 4	109 16	8 4	1 4 1	2	172 4 4	4 129	21 8 268 4	20 4 4 9	225 22	==	$\pm \pm \pm$	=	
тандартисация и технические	·	4 4 36	72 72 8 144 144 12	119 13	 	1 1 1		 	- 	+	- - 			+		-	 	1111	 	\neg	1111	` 	 ^ * -	6 2	1 4	1 1	130 4	2 119	n		+	+	+++	+++	55 Kadegpa xweer 9K-3; VK-8 56 Kadegpa xnecrporexweer RK-6
хиожодства электронных средств 7		5 5 %	190 190 22	136 13												$\overline{}$							1	144 2 S	4 2	115 13 1	3 4	2 9 21				\bot			о бафера конструкрования и теннологии пк-5; ПК-9 электронных систем и устройств
онствонна электронных средств 7 энеством электронных средств 6		4 4 36	344 344 35 344 344 12 180 380 36	119 13	 				-	+	+		\vdash	-		-	 	6 2	1	-	4 130	4 2	119 13	266 2 6	1 2	113 12		\Box			+	+	++	++F	кафера радистично (Ж.4; Ж.1 60 Кафера контрукрования и теннологии (Ж.4; Ж.1)
компоненты электронных средств 2					6 2 4			S 174	8 2	151	a																								30 Кафара конструирования и теннологии пк-7 влестронных систем и устройств
полические соковы электронных средств 5 электичны	6	6 6 36	206 216 16	178 13	+	\perp			\perp	\perp	\perp	\perp		\Box		\vdash	\Box	5 180 2 4	4 2	155 13	: 3	2 2 9	23		$\perp \perp \perp$				\perp	\bot	+	\bot	+	$+$ \mp \mp	О Кафара конструкрования и темпологии ПК-1
meneru	s	1 1 16	100 100 12	88 B	+	+		$\overline{}$	+	+	+			-		\rightarrow	+	3 108 2 8	2	ss s				-				$\overline{}$		$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	+++	+++	+++	+++	з постронных систем и устройств (ж. 7) К. 7)
onextpowers S		7 7 36	20 20 34	202 17	+	+			\rightarrow	\rightarrow	+			\bot		#	+	4 344 4 8	4 2	113 13	2 238		151 13 89 4							##	\pm	$\Rightarrow\Rightarrow$	\pm	##	занстронных систем и устройств 27 Кафедра радистичения 38-7
opean tesessa S	7 8	8 8 %	299 299 29	234 17	++-	+		$\overline{}$	+++	\rightarrow	+	-	-	+	$\overline{}$	-	+++	 	 	\rightarrow		 	1 1 1 2	134 4 8	4 2	aa a s	174 8	2 9 146	·	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	+++	+++	+++		а пафера конструкращим и теннологии пк-3; пк-6 констронено систем и истройств Софера конструкращем и теннологии
ства электронных средств е ооновы конструирования, технологии 0	6	1 1 1 16	100 900 12 100 100 10	68 B	+++	+++			+	+	+		-		-	-	+++	6 2	1	\rightarrow	3 10	4 2		6 2	1.		04 10	2 40			+	\rightarrow	++-	+ '	завеспромене систем и истройств (IX-4; ПК-5; П (IX-6) ПК-6; ПК-
ручрования интегральных никроскен	2 2	1 1 16	100 100 12	E2 4	+++			 		-	+					-	 	-					1 1	6 2 108 2 4	4 2 9	ED 4		 	" 		+		++-	+++	алистронных систем и устройств Каферра исиструарования и технологии 60 исиструарования и технологии пк3
ых исследований	7	2 2 36	72 72 12	52 B	1 1 1	1 1 1			1 1 1														2	72 2	8 2	Ω 8									30 Кафеда конструирования и технологии пк-1; пк-2 иметронных систем и устройств
приого анализа качества электронных	7	2 2 36	72 72 12 72 72 8	52 B	\perp	+			\rightarrow	\rightarrow	+	-		\perp		\leftarrow	+	$\overline{}$	$\overline{}$	\rightarrow	$\overline{}$	\perp	2	72 2 4	4 2	2 4	$\overline{}$					\rightarrow	\rightarrow	++++	Д Кафера конструирования и технологии пк-2; пк-5; п завстрочных систем и устройств
нформатика	1	4 4 %	144 144 16	120 8							4 144	2 12	2 1	20 8															1 1 " 1 1			$\neg \neg$			10 Кафедра конструирования и технологии пк-3
урсы по физической культуре и спорту и по выбору Б1.8.08.01	<u> </u>	2 2 3	208 228 12 72 72 12	124 4 S2 8	329		224 4		\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow			\rightarrow		#	+				\rightarrow		1	72 2	8 2	2 4					\pm		##	##	I Кафеда физиспитания W-4; УК-7
пентродичения и СВЧ истройства и по въибору 61.8.09.02	7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2	72 72 12 26 216 24	2 s	+				\rightarrow	\rightarrow									2 2 9											\rightarrow	+	\rightarrow	\rightarrow	###	2 Cadessa passersono (K-2
истерного проектирования электронных	4 S	6 6 36	216 216 24	175 8							0,25 10	2 8		4,75	170 8	2	152 8	1 %	2 2 9	23															 Кафедра конструирования и технологии пк-1; пк-3 влектронных систем и устройств
X considery 61 8 69 60	4 S	6 6 36	216 216 24	175 B	+	+		$\overline{}$	+	-	0,25 10	2 8	-	4,75	170 8	2	152 8	1 %	2 2 9	23	-		\vdash	-	-	$\overline{}$	-	$\overline{}$	2 22 2		55 4	$\rightarrow \rightarrow$	+++	+++'	 Кафеда конструирования и технологии пк-1; пк-3 деястронных систем и устройств
и эксперинента	9	2 2 36	72 72 B	56 B												\rightarrow													2 72 2	4 2	56 B	\bot	\bot		60 Кафедо конструирования и технологии 19-2 электронных систем и устройств
и вероитности и натенатичноски и по въибору Б1.0.00.04	,	2 2 36	72 72 8 109 109 12	56 B	++-	+		$\overline{}$	+++	\rightarrow	+	\rightarrow	\vdash	+	$\overline{}$	+	+++	\rightarrow	+	\rightarrow	+	+	\vdash	++-	++-	$\overline{}$	\rightarrow	\longrightarrow	2 72 2	4 2	55 8	\rightarrow	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	+++	4 Кафеда высыей натематики ПК-2
мросборок с нерепутирнай структурай	9	3 3 36	108 108 12	68 S																									3 108 2	8 2	60 0				до Кафедра конструирования и технологии пк. 6; Пк. 6; П констроичес систем и истройств
epoclopox roo surSopy 51.8.59.65	9	3 3 36	100 100 12	20 0 (20 6	+	+		$\overline{}$	+	\rightarrow	+	-		\perp		+	+++	-	$\overline{}$	\rightarrow	-	-	\vdash	1. 1.					3 100 2	8 2	89 8	$\rightarrow \rightarrow$	+++		
		4 4 36	144 144 15	120 8																				6 2 4		1		2 120	0						
rtansi Lon audioru E1 8 69 66		4 4 36	144 344 16 144 344 16 144 344 16 144 344 16	120 8	+	+		$\overline{}$	+	\rightarrow	+	-	-	-		+	+++	-	$\overline{}$	\rightarrow	-	-	\vdash	6 2 4		1	120 0	2 120	4 14 2		115 13	$\rightarrow \rightarrow$	+++	+++'	 Кафеда конструирования и технологии деястроиных систем и устройств пк-6; пк-6; п
martawal PDC 9		4 4 36	144 144 15	115 13																									4 144 2	12 2	115 13				до Кафедра конструирования и технологии пк-2; пк-5 илистронных систем и устройств
COM HONTONS 9		4 4 %	344 344 36 344 344 36	115 13	+++	+++		$\overline{}$	+++	\rightarrow	+	-	-	\perp		\leftarrow	+++	-	\perp	-	-	\perp	\vdash	-	-	$\overline{}$	-	\Box	4 144 2	12 2	115 13	\rightarrow	+++	+++'	ванепронных систем и устройств ПК-2; ПК-5
яне процессы XC и их агтестация 9		4 4 %	144 144 16	115 13																									4 144 2	12 2	115 13				до Кафеда конструирования и технологии пк-5; пк-6 констронног систем и устройств
ue revenance 9		4 4 36	144 144 15	115 13	$\overline{}$				$\overline{}$	\rightarrow	+	+	\perp	\perp	\Box	$\overline{}$	++	\perp	+	$+$ \top	+		\vdash	\perp		\vdash		\Box	4 144 2	12 2	115 12	+	++	+	а варедов конструирования и технологии пк-5; Пк-6 электронных систем и устройств
ванные системы контроля и	9	2 2 36	72 72 S	56 B																									2 72 2	4 2	56 B				56 Kadegpa электротехняки (16-4; П6-5; П
mesi compone 3C			72 72 S					$\overline{}$	+	+	+	-		\perp		+	+++	7 7 7		0 4	-	-	\vdash	-		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	2 72 2	4 2	56 B	$\rightarrow \rightarrow$	+++	+++'	 Вафеда конструирования и технологии пк-4; пк-5; пг ванитающих систем и истройств
и нежультурная комунисация	5 5	2 2 %	72 72 12	52 B												\Box		2 72 4	6 2	2 4															25 Кафеда управления человеческими WK-4; VK-5
KOMMONOSTYSTIANE TERROCOCYM	\$	2 2 3 2 2 3	72 72 12 72 72 12	22 8 22 8												=	$\overline{}$	2 72 4 2 72 4	6 2	Ω # Ω #										=	$\pm \pm \pm$	\rightarrow	\pm	1	 Сеферра социальных систем и повка W.4; W.5 Кафиара философии W.4; W.5
н по выбору Б1.8./(В.10 коночанной культуры ция профессионального развития	1	2 2 3 2 2 3 2 2 3	72 72 12 72 72 12	2 8 2 8	+++			\vdash	\rightarrow	+	+	+		+	\vdash	=	+	1111	+	Ω 4	2 8	1 2 2	2 4				\rightarrow		+		+	$\Rightarrow \Rightarrow$	++		В Софера менеджента W-10, УК-6 20 Софера менеджента W-10, УК-6
		105 105 214 214	4108 4108 408 8032 8032 818	354 292 531 611 233	234 2 4 1 200 30 12	2 52 14	224 4 996 76	\$ 124 26,5 628	8 2 36 4 12	151 909	3 425 154 8 23 94	4 20 28 60 12	2 12 7	20 8 4.75 54 60 21,5	120 4 794 24	12 10	\$ G2 22 G2	15 S64 24 2 23 858 34 3	38 20 9 38 25 28	401 40 602 68	2 (% 2 E2	5 5 H B 5 X B B	28 H 20 6E N 2	74 22 X 72 X X	44 34 9 46 34 9	50 G B	600 30 4 600 34 6	10 18 555 14 18 684	0 17 60 12 44 25 900 16	40 4 12 60 8 16 9	406 50 711 80			$\pm \pm \pm$	
																														==		=	==	== =	Kitani arangana a manara
ная практика	4	4 4 %	144 144 2 144 144 2	139 4						_		\perp		1 1	246	2 2	128 4						\Box								+	\rightarrow			раметронных систем и устройств
		4 4 36	144 144 2	120 4				$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$		=		$\overline{}$			$\overline{}$	$\overline{}$			$\overline{}$	- 4	344	2 128	4	=	+	$\overline{}$		$\overline{}$	60 Кафедра конструкрования и технологии ПК-5; ПК-8; Г
реательская работа	10	8 8 36	288 288 2	292 4												\rightarrow																8 298	2	292 4 6	60 Кафеда конструирования и технологии влестронных окстен и устройств
и граспиа	90	4 4 26	344 344 2	120 4												\rightarrow															\perp	4 144	2 4 4	139 4 6	а Кафара конструирования и технологии ПК-3; ПК-4; П этектронных систем и устройств
no attroctaures		2 2	20 26 6 720 720 8	006 12 006 16				\Box		\pm	\pm	\pm		1 1	344		138 4			\rightarrow						1 1 1 1	344 344	2 138 2 138	1		##	¥ 10 2 10	- 	100 11	
man accord market accord																=														=		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{-}$	Cohera con Tourness a Tourness Disk t; ONC.
		6 6 %	266 216 2	205 9	+++	+			+	+	+		\vdash	\perp	\square	\leftarrow	+++	\perp	+	\rightarrow	\perp			+++	+++	\vdash	\perp	\vdash	+		+	6 216	2	205 9 6	60 Кафедра конструирования и технологии (Ки-1; ОПК-1 (Ки-1; ПК-5; П Ки-2; УК-4; И
		6 6	256 216 2	205 9			\vdash													_						-						6 286	طنلت	285 0	
ий неразрушающий контроль		2 2 %	2 2 2	SS 4	T T	$\overline{}$			1 1 1							$\overline{}$	1 1 1	1 1 1			1 1 1								2 72 3	4 4 2	56 4	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	60 Кафера конструирования и технологии ду. э- го. 4
		1 1 1 1	72 72 12 72 72 10	56 4 56 4	+	+			\rightarrow	+	+	\rightarrow		+		=	+	\rightarrow	+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow					\rightarrow		2 72 2 2 72 3	4 4 2 4 4 2 4 4 2	1 1 1	$\Rightarrow \Rightarrow$	++	##	вметронных систем и устройств
-																$\overline{}$																$\overline{}$			

Индекс	Наименование	Формирование компетенции
	Дисциплины (модули)	OTIK-1; OTIK-2; OTIK-3; OTIK-4; OTIK-5; TK-1; TK-2; TK-3; TK-4; TK-5; TK-6; TK-7; TK-8; TK-9; YK-1; YK-10; YK-2; YK-3; YK-4; YK-5; YK-10; YK-1
10		[VK-7; VK-8; VK-9
1.0	Обязательная часть	OTIK-1; OTIK-2; OTIK-3; OTIK-4; OTIK-5; YK-1; YK-10; YK-2; YK-3; YK-4; YK-5; YK-6; YK-7; YK-8; YK-9
51.0.01	Математика	Offic-1
51.0.02	Линейная алгебра	OTK-1
51.0.03	Физика	OTK-1; OTK-2; VK-1
Б1.О.04	Прикладная механика	OTK-1; OTK-4
Б1.О.05	Программирование на алгоритмических языках	ONK-3; ONK-4; ONK-5
Б1.О.06	Основы физики твердого тела	OПК-2
Б1.О.07	Информационные технологии	ONK-3; ONK-4; ONK-5
Б1.О.08	Инженерная и компьютерная графика	ONK-4
Б1.О.09	Основы управления техническими системами	OTK-1; OTK-2
Б1.О.10	Основы конструирования электронных средств	ОПК-2; ОПК-4
51.0.11	Химия	OΠK-1; OΠK-2
B1.0.12	История (история России, всеобщая история)	УК-1; УК-5
51.O.13	Философия	УК-1; УК-5
	Иностранный язык	
Б1.O.14		YK-4; YK-5
51.O.15	Безопасность жизнедеятельности	VK-8
Б1.0.16	Управление проектами в профессиональной деятельности	УК-2; УК-3; УК-9
51.0.17	Электротехника	OTIK-1; OTIK-2
Б1.О.18	Электроника	OПK-1; OПK-2
Б1.О.19	Введение в специальность	OПK-1; VK-1; VK-2
Б1.О.20	Промышленный дизайн	ОПК-4
Б1.О.21	Экономика и организация производства	УК-1; УК-10; УК-2; УК-9
Б1.O.22	Физическая культура и спорт	УК-6; УК-7
	Часть, формируемая участниками образовательных	
В	отношений	NK-1; NK-2; NK-3; NK-4; NK-5; NK-6; NK-7; NK-8; NK-9; VK-1; YK-10; YK-2; YK-3; YK-4; YK-5; YK-6; YK-7; YK-8
51.B.01	Экология	УК-2; УК-8
51.B.02	Метрология, стандартизация и технические измерения	7N-2, 7N-0 TIK-6
51.B.03		
	Технология производства электронных средств	ПК-5; ПК-9
51.B.04	Схемо- и системотехника электронных средств	ПК-6; УК-1
51.B.05	Управление качеством электронных средств	IIK-4; YK-3
51.B.06	Материалы и компоненты электронных средств	RK-7
Б1.B.07	Физико-технологические основы электронных средств	TK-1
Б1.В.08	Электрорадиоэлементы	IK-7
Б1.В.09	Основы технологии электронной компонентной базы	ΠK-2; ΠK-5
Б1.В.10	Основы радиоэлектроники	ПК-7
Б1.В.11	Микропроцессорная техника	ПК-3; ПК-6
Б1.В.12	Контроль качества электронных средств	ПК-4; ПК-5; ПК-6
	Теоретические основы конструирования, технологии и	
Б1.В.13	надежности	ПК-3; ПК-5; ПК-6
Б1.В.14	Основы конструирования интегральных микросхем	ПК-3
Б1.В.15	Основы научных исследований	TIK-1; TIK-2
51.B.16		
	Основы кластерного анализа качества электронных средств	INK-2;
51.B.17	Основы радиотехнических систем	INC-3
51.B.18	Прикладная информатика	IIK-3
Б1.В.19	Элективные курсы по физической культуре и спорту	УК-6; УК-7
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01	ПК-3
Б1.В.ДВ.01.01	Проектирование микроволновых устройств	ПК-3
Б1.В.ДВ.01.02	Техническая электродинамика и СВЧ устройства	ПК-3
Б1.В.ДВ.02	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02	ΠK-1; ΠK-3
Б1.В.ДВ.02.01	Основы компьютерного проектирования электронных систем	ΠK-1; ΠK-3
Б1.В.ДВ.02.02	Основы САПР ЭС	ПК-1; ПК-3
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	ПК-2
Б1.В.ДВ.03.01	Основы теории эксперимента	TIK-2
Б1.В.ДВ.03.02	Основы теории эксперимента Основы теории вероятности и математической статистики	
Б1.В.ДВ.04	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04	TK-5; TK-6; TK-8; TK-9
Б1.В.ДВ.04.01	Технология микросборок с нерегулярной структурой	IK-5; IK-6; IK-8; IK-9
Б1.В.ДВ.04.02	Технология микросборок	ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9
Б1.В.ДВ.05	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05	NK-5; NK-6; NK-8
Б1.В.ДВ.05.01	Технология микродеталей	ПК-5; ПК-6; ПК-8
Б1.В.ДВ.05.02	Технология деталей	ПК-5; ПК-6; ПК-8
Б1.В.ДВ.06	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06	пк-2; пк-5
Б1.В.ДВ.06.01	Технология испытаний РЭС	пк-2; пк-5
Б1.В.ДВ.06.02	Исследовательские испытания	ΠK-2; ΠK-5
		TIK-5; TIK-6
	ІЛисциплины по выбору Б1.В ЛВ О7	
Б1.В.ДВ.07	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07	
Б1.В.ДВ.07 Б1.В.ДВ.07.01	Технологические процессы ЭС и их аттестация	ПК-5; ПК-6
Б1.В.ДВ.07 Б1.В.ДВ.07.01 Б1.В.ДВ.07.02	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии	NK-5; NK-6 NK-5; NK-6
61.B.ДB.07 61.B.ДB.07.01 61.B.ДB.07.02 61.B.ДB.08	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08	IR-5; IR-6 IR-5; IR-6 IR-4; IR-5; IK-6
Б1.В.ДВ.07 Б1.В.ДВ.07.01 Б1.В.ДВ.07.02 Б1.В.ДВ.08 Б1.В.ДВ.08.01	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС	NK-5; NK-6 NK-5; NK-6 NK-4; NK-5; NK-6 NK-4; NK-5; NK-6
Б1.В.ДВ.07 Б1.В.ДВ.07.01 Б1.В.ДВ.07.02 Б1.В.ДВ.08 Б1.В.ДВ.08.01 Б1.В.ДВ.08.01	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС	ПК-5; ПК-6 ПК-5; ПК-6 ПК-4; ПК-5; ПК-6 ПК-4; ПК-5; ПК-6
61.B.ДB.07 61.B.ДB.07.01 61.B.ДB.07.02 61.B.ДB.08 61.B.ДB.08 61.B.ДB.08.01 61.B.ДB.08.02 61.B.ДB.09	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.09	IR5; IR6
E1.B.JB.07 E1.B.JB.07.01 E1.B.JB.07.02 E1.B.JB.08 E1.B.JB.08.01 E1.B.JB.08.02 E1.B.JB.08 E1.B.JB.08.02 E1.B.JB.09 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация	RK-5; RK-6 RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 YK-4; YK-5 YK-4; YK-5
E1.B./JB.07 E1.B./JB.07.01 E1.B./JB.07.02 E1.B./JB.08.08 E1.B./JB.08.01 E1.B./JB.08.02 E1.B./JB.08.02 E1.B./JB.09.01 E1.B./JB.09.01 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.09	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.6; IR.6; IR.6 IR.6;
E1.B.JB.07 E1.B.JB.07.01 E1.B.JB.07.02 E1.B.JB.08 E1.B.JB.08.01 E1.B.JB.08.02 E1.B.JB.08 E1.B.JB.08.02 E1.B.JB.09 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01 E1.B.JB.09.01	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.в.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.в.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология	RK-5; RK-6 RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 RK-4; RK-5; RK-6 YK-4; YK-5 YK-4; YK-5
E1.B./JB.07 E1.B./JB.07.01 E1.B./JB.07.02 E1.B./JB.08.08 E1.B./JB.08.01 E1.B./JB.08.02 E1.B./JB.08.02 E1.B./JB.09.01 E1.B./JB.09.01 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.02	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межукрътурная коммуникация Современные коммуникативные технологии	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.6; IR.6; IR.6 IR.6;
Б.1.В.ДВ.07 Б1.В.ДВ.07.01 Б1.В.ДВ.07.02 Б1.В.ДВ.08 Б1.В.ДВ.08 Б1.В.ДВ.08.02 Б1.В.ДВ.09 Б1.В.ДВ.09.01 Б1.В.ДВ.09.02 Б1.В.ДВ.09.03 Б1.В.ДВ.09.03 Б1.В.ДВ.09.03 Б1.В.ДВ.09.03	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.10	RK-5; RK-6 RK-5; RK-6 RK-4; YK-5 YK-4; YK-6 YK-10; YK-6
E.1.B., J.B. 0.7	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль и суправления ЭС Дисциплины по выбору Б.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6
S1.B.J.B.07 S1.B.J.B.07.01 S1.B.J.B.07.02 S1.B.J.B.08 S1.B.J.B.08 S1.B.J.B.08 S1.B.J.B.09 S1.B.J.B.09 S1.B.J.B.09.01 S1.B.J.B.09.02 S1.B.J.B.09.03 S1.B.J.B.09.03 S1.B.J.B.09.03 S1.B.J.B.10	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития	IR.5; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6
S1.B.J.B.07	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль и управления ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.6 IR.4; IR.6 IR.4; IR.6 I
S1.B./JB.07 S1.B./JB.07.01 S1.B./JB.07.02 S1.B./JB.08 S1.B./JB.08 S1.B./JB.08 S1.B./JB.08 S1.B./JB.09 S1.B./JB.09 S1.B./JB.09 S1.B./JB.09.02 S1.B./JB.09.03 S1.B./JB.09.03 S1.B./JB.10 S1.B./JB.10.01 S1.B./JB.10.01 S1.B./JB.10.01 S1.B./JB.10.02 S1.B./JB.10.02	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть	IR.5; IK.6
S1.B.J.B.07	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.8.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.6 IR.4; IR.6 IR.4; IR.6 I
E1.B./JB.07 E1.B./JB.07.01 E1.B./JB.07.02 E1.B./JB.08 E1.B./JB.08 E1.B./JB.08 E1.B./JB.08 E1.B./JB.09 E1.B./JB.09 E1.B./JB.09 E1.B./JB.09.02 E1.B./JB.09.03 E1.B./JB.09.03 E1.B./JB.10.01 E1.B./JB.10.01 E1.B./JB.10.01 E1.B./JB.10.01 E1.B./JB.10.02 E2.O.01(V)	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных	IRK-5; IRK-6
S1.B.JB.07	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений	IR.5; IK.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6; IR.6; IR.6; IR.7; IR.8; IR.8; IR.8; IR.7; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8; IR.8;
E1.B.JB.07	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль и управления ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений Технологическая (проектно-технологическая) практика	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.1; IR.6; IR.6; IR.7; IR.6; IR.7; IR.8; IR.9;
S1.B.JB.07	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений	IR.5; IK.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6; IR.6; IR.6; IR.7; IR.8; IR.8; IR.8; IR.9;
S.I.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.8 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 1.0 SI.B., JB.	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений Технологическая (проектно-технологическая) практика Научно-исследовательская работа	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.1; IR.6; IR.6; IR.7; IR.6; IR.7; IR.8; IR.9;
E1.B.JB.07	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений Технологическая (проектно-технологическая) практика Научно-исследовательская работа Преддипломная практика	IR.5; IK.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6 IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.7; IR.8; IR.9; IR.9; IR.9; IR.9; IR.9; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.7; IR.8; IR.9; IR.9; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.7; IR.8; IR.9; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.6; IR.7; IR.8; I
S.I.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.8 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 1.0 SI.B., JB.	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений Технологическая (проектно-технологическая) практика Научно-исследовательская работа	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.6; IR.6; IR.7; IR.8; IR.8; IR.8; IR.9; IR.8; IR.9; IR.8; IR.9; IR.8; IR.9; IR.8; IR.9; IR.8; IR.9; IR.8;
S1.8, JB. 0.7	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.В.Д.В.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б.В.Д.В.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б.В.Д.В.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений Технологическая (проектно-технологическая) практика Научно-исследовательская работа Преддипломная практика Государственная итоговая аттестация	IRK-5; IRK-6 IRK-5; IRK-6 IRK-5; IRK-6 IRK-4; IRK-7; IRK-7; IRK-8; IRK-9;
S.I.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.7 SI.B., JB. 0.8 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 0.9 SI.B., JB. 1.0 SI.B., JB.	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений Технологическая (проектно-технологическая) практика Научно-исследовательская работа Преддипломная практика	IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.4; IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.1; IR.6; IR.7 IR.4; IR.7 IR.4; IR.7 IR.5; IR.6; IR.7 IR.4; IR.7 IR.5; IR.6 IR.4; IR.7 IR.5; IR.6 IR.5; IR.6 IR.6; IR.6 IR.6; IR.6 IR.7 IR.8 IR.9 IR.7
S1.8, JB. 0.7	Технологические процессы ЭС и их аттестация Ионоплазменные технологии Дисциплины по выбору Б.В.Д.В.08 Автоматизированные системы контроля и управления ЭС Производственный контроль ЭС Дисциплины по выбору Б.В.Д.В.09 Деловая этика и межкультурная коммуникация Современные коммуникативные технологии Культурология Дисциплины по выбору Б.В.Д.В.10 Основы профессиональной культуры Самоорганизация профессионального развития Практики Обязательная часть Ознакомительная практика Часть, формируемая участниками образовательных отношений Технологическая (проектно-технологическая) практика Научно-исследовательская работа Преддипломная практика Государственная итоговая аттестация	IRK-5; IRK-6 IRK-5; IRK-6 IRK-5; IRK-6 IRK-4; IRK-7; IRK-7; IRK-8; IRK-9;

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 110303-2020-3-ПП-4г08м-51.plx, код направления 11.03.03, год начала подготовки 2020

1 7,	Е ДАППЫЕ 110303-2020-3-1111-4200м-31.ры, коо и	7		гого			Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Курс 5	
		Баз.%	Bap.%	ДВ(от Вар.)%	ЗЕТ Факт	Всего	Сем 1	Сем 2	Всего	Сем 3	Сем 4	Всего	Сем 5	Сем 6	Всего	Сем 7	Сем 8	Всего	Сем 9	Сем 10
	Итого (с факультативами)			Bup.)/ 0	242,00	50,00	23,50	26,50	52,00	26,50	25,50	47,00	23,00	24,00	48,00	20,00	28,00	45,00	27,00	18,00
	Итого по ОП (без факультативов)				240,00	50,00	23,50	26,50	52,00	26,50	25,50	47,00	23,00	24,00	48,00	20,00	28,00	43,00	25,00	18,00
Б1	Дисциплины (модули)	50,9	49,1	29,5	214,00	50,00	23,50	26,50	48,00	26,50	21,50	47,00	23,00	24,00	44,00	20,00	24,00	25,00	25,00	
Б1.О	Обязательная часть				109,00	45,00	23,50	21,50	39,00	22,25	16,75	12,00	8,00	4,00	5,00		5,00	8,00	8,00	
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений				105,00	5,00		5,00	9,00	4,25	4,75	35,00	15,00	20,00	39,00	20,00	19,00	17,00	17,00	
Б2	Практика	100	0		20,00				4,00		4,00				4,00		4,00	12,00		12,00
Б2.О	Обязательная часть				20,00				4,00		4,00				4,00		4,00	12,00		12,00
Б2.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений																			
Б3	Государственная итоговая аттестация	100	0		6,00													6,00		6,00
ФТД	Факультативные дисциплины	100	0		2,00													2,00	2,00	

	ЭКЗАМЕНЫ (Экз)	8	4	4	7	4	3	6	4	2	6	2	4	5	4	1
	ЗАЧЕТЫ (За)	3	2	1	1	1		5	1	4	5	4	1	3	3	
	ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)	2	1	1	4	1	3	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Обязательные формы контроля	КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)										2	1	1	1	1	
	КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)							4	2	2	1		1			
	КОНТРОЛЬНЫЕ (К)															